

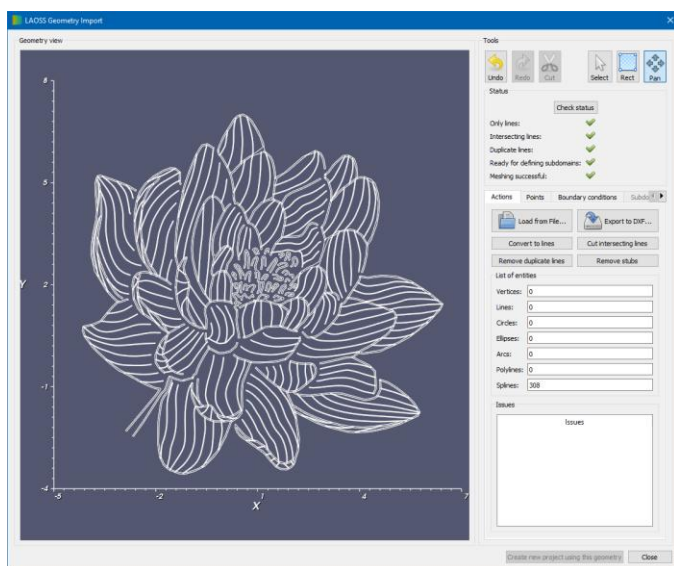
# Fluxim Newsletter 2018

有機エレクトロニクスにおける研究開発支援に関するリリース3つを中心にご紹介します。

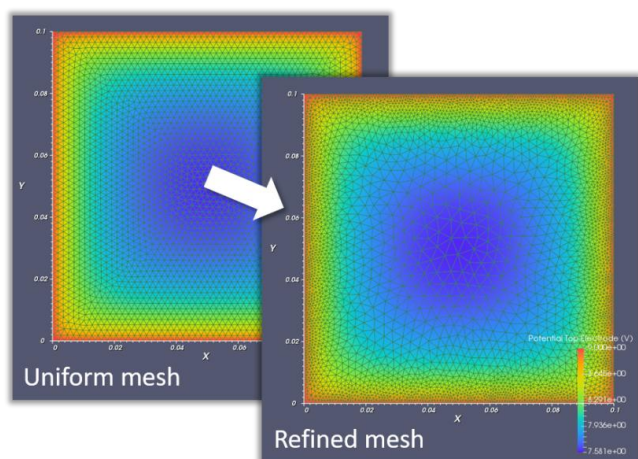
- Laoss3.0 では、“adaptive meshing”と、よりユーザーが使いやすい”advanced layouts”のインポートが追加されました。
- Paios では温度制御測定が簡単に行える、新しいペルチェ温度制御モジュールがリリースされました。
- Phelos と Paios を制御する新しいエンジン”Fluxim Characterization Suite version 4.1”がリリースされました。
- 測定例ハイライト：Phelos と Setfos を組み合わせた発光材料の配向測定。
- Setfos 4.6.3 でのエラーが見つかり、修正しました。

## ● Laoss 3.0

Laoss3.0 では複雑なジオメトリが複雑でなくなります。Laoss3.0 では、インポートされたレイアウトが Laoss でのシミュレーションに適合しているか確認する”geometry import wizard”を導入し、パラメーターを正しい場所に割り当てることを支援致します。一般的な非互換性を自動で修正することもできます。



Laoss3.0 のもうひとつの新しい特徴は、“adaptive mesh refinement”です。“Mesh refinement”により、ジオメトリの細部付近では細かくバルクでは粗くなるよう改良された効率的なメッシュが作成されます。



## ● ペルチェ温度制御

温度制御測定により、デバイスや材料の解析を次のレベルに上げることができます。ペルチェ温度制御モジュールを備えた Paios で、この強力な方法を簡単に使うことができます。ペルチェ温度制御モジュールは水冷式と空冷式があり、それぞれの温度範囲は $-50\sim+80^{\circ}\text{C}$ および $-20\sim+80^{\circ}\text{C}$ です。

ペルチェ冷却により、容器を液体窒素で満たすことなく、電源ケーブルにつないで冷却を開始することができます。



このペルチェモジュールは、OLED および太陽電池用のオールインワン電気特性評価プラットフォーム(Paios)に対する拡張機能です。

## ● Fluxim Characterization Suite 4.1

Fluxim Characterization Suite 一つで、Paios と Phelos で測定を行い、比較し、解析することができます。Characterization suit で以前の Paios ソフトを置き換えることができます。Paios で使っていた機能性は全て引き継がれ、更に拡張されています。

Fluxim Characterization suite 4.1 では以下の機能を導入しております。

- 可動性イオンの動きを電氣的にシミュレーションする Setfos 4.6 との統合
- 温度制御測定におけるアレニウスプロットを簡単に作成
- Phelos の測定制御
- ペルチェ温度モジュールの制御
- SMU モジュールからの電流パルスを発生
- その他、多くの機能と改良

## ●測定例ハイライト：エミッター配向測定

発光材料の配向性は、今もなお OLED の発光材料において強く求められている特性です。[Phelos](#) の PL 測定と [Setfos](#) の発光領域解析により、新しい発光材料の配向を素早く正確に解析することができます。

